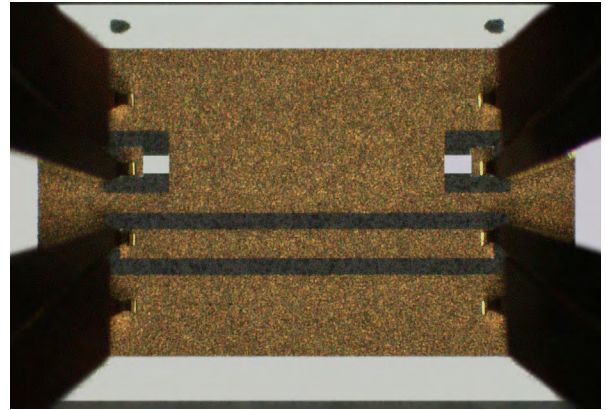


TCS-GSSG-0150-0200 Calibration Substrate

MPI TITAN™ TCS-GSSG-0150-0200デュアル校正基板は、GSSGチップ構成を持つMPI TITAN™ RFプローブの精度の高いRF校正を可能にするように設計されています。この標準器のレイアウトは、PlanarCalコンソーシアムに所属する12のヨーロッパの組織によって開発された推奨事項を実装して最適化されています[1]。この校正基板は業界標準のShort-Open-Load-Thru (SOLT/TOSM) 校正法だけでなく、先進的なThru-Match-Reflect (TMR/LRM)、Thru-Match-Reflect-Reflect (TMRR) およびNISTのマルチラインThru-Reflect-Line (mTRL) 校正法にも対応しています。

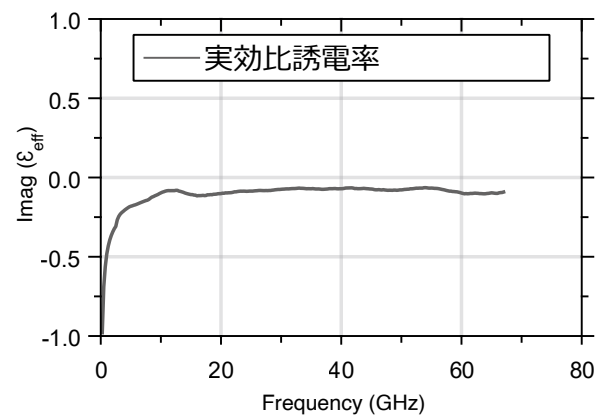
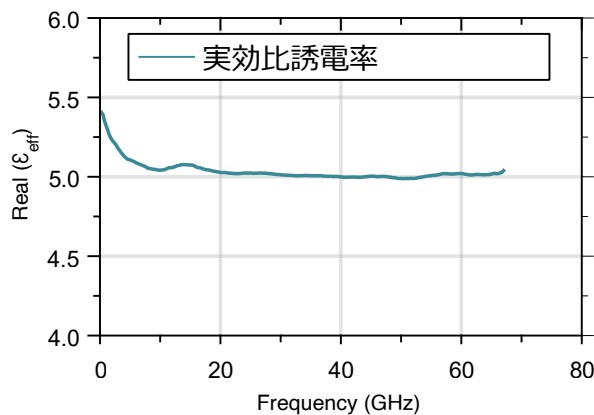
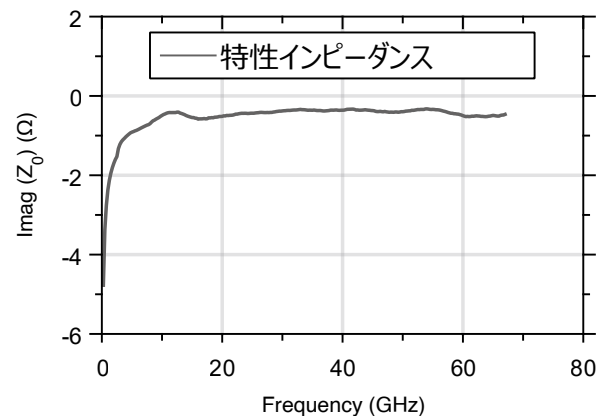
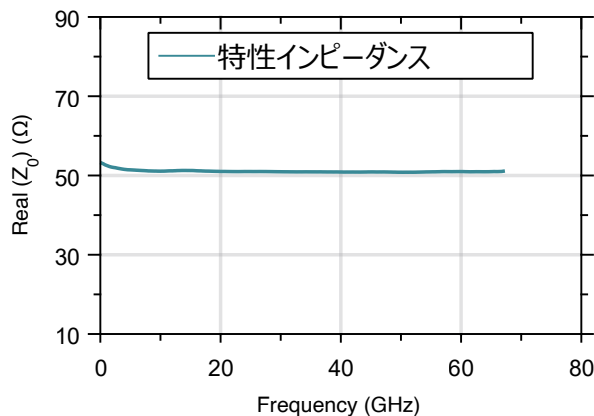
TCS-GSSG-0150-0200には最高140 GHzまでのmTRL校正用の完全なコプレーナ伝送線セットが含まれています。

MPIのTCSデュアルRF校正基板ファミリに実装されたアイドルRFプローブ・ポートを隣接する負荷で終端する独自のアプローチにより、ミリ波周波数帯でRF校正精度が大幅に向上します[2]。



2つの向かい合ったGSSG TITAN™デュアルプローブを10μmの垂直オーバトラベルでThru (Adj Load)標準器に触れた後、プローブを離れた時の写真。

代表的電気特性



RF校正基板仕様

材質	アルミナ
大きさ	16.7 mm x 12.7 mm
厚さ	254 μ m
標準器設計	コプレーナ
プローブ構成	GSSG
サポートピッチ幅	150 ~ 200 μ m
校正および検証ラインの数	3
校正検証エレメント	有り
サポートされるRF校正法	TOSM (SOLT), TMR, LRM, SOLR, TMRR, TRL & mTRL
ロード抵抗値 (代表値)	50 Ω
ロード・トリミング精度 (代表値)	$\pm 0.3 \%$
オープン標準器	基板に金パッド
TITAN™ プローブの推奨オーバトラベル	10 μ m

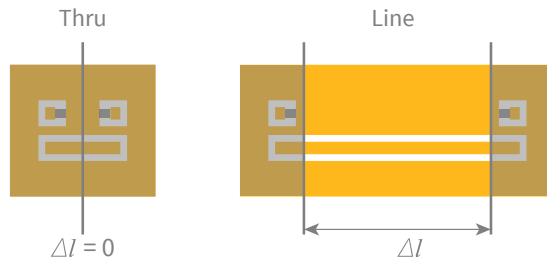
CPW標準ライン電気特性

単位長当たり公称容量 (pF/cm)	1.465
公称特性インピーダンス @20 GHz	50 Ω
実効比誘電率(実数部) @20 GHz	5.07
速度係数@20 GHz	0.444
単純化ラインモデル・パラメータ	
基準損失(dB)	0.2
基準遅延時間(ps)	10
基準周波数(GHz)	30
ラインの電気長(ps)	
Thru (Adj Load)	5.63
Thru (Adj Load) 1 (0201,0206)	8.26
Thru (Adj Load) 2 (0301,0306)	13.37
Thru (Adj Load) 3 (0401,0406)	28.54
Dual Thru (0103, 0104, 0203, 0204)	5.70
Vertical Thru (0502 - 0505)	1.78

NIST マルチライン TRL(m TRL)校正を使った校正精度

mTRL校正キットは、DUTと同じ半導体プロセスを使用して簡単に設計および製造することができます。カスタマイズされた「オンウエハ」mTRL校正キットを使用することで、DUTの測定結果からデバイスのパッドの寄生インピーダンスをデエベディングする必要がなくなります。mTRLは220GHzを超える測定周波数で信頼できる校正結果を提供できる唯一の方法です。

mTRLアルゴリズムは、異なる物理長の複数のライン標準器を必要とし、常に最初のライン（「スルー」）標準器をゼロ長のラインとして扱います。後続のライン標準器の長さであるDelta-lは、スルー（最初のライン）の長さに対して定義されます。



TRLライン標準器の Δl の定義



MP80-DXマイクロポジショナ。
X軸のデジタル・マイクロメータ使用

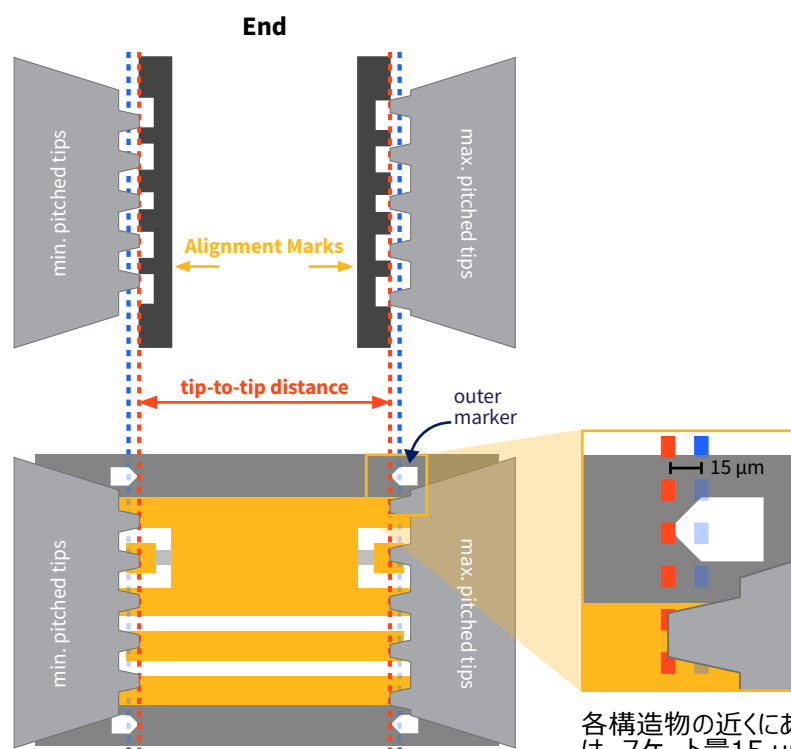
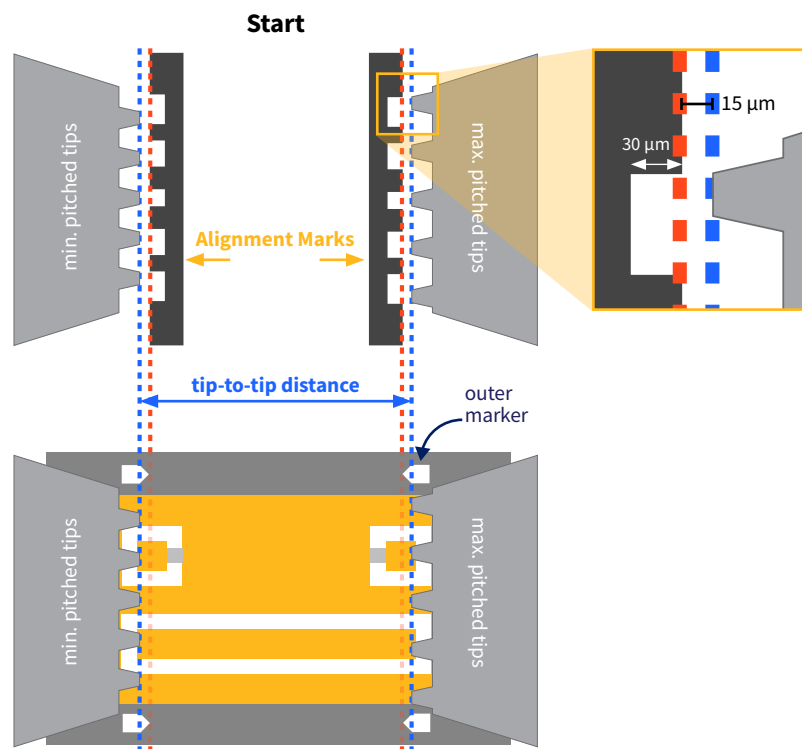
標準器タイプ (名称)	物理長 (μm)	実使用長 l (μm)	Δl (μm)
Thru (Adj Load)	800	750	0
Thru (Adj Load) Line 1 (0201,0206)	1150	1100	350
Thru (Adj Load) Line 2 (0301,0306)	1830	1780	1030
Thru (Adj Load) Line 3 (0401,0406)	3850	3800	3050

プローブの位置決めおよび アライメント・マーク

プローブ先端を校正用標準器に正しく設定することは、正確で再現性のあるシステム校正にとって非常に重要です。MPI TITAN™ TCS校正基板は、お客様がプローブ先端を標準器に正しく設定できるよう、特別な構造を持つマークを提供しています。これらの構造（アライメント・マーク）により、ショート、オープン、ロードおよびスルー標準器に正しい位置でプローブ先端が接触し、正確で再現性のある校正結果を得ることができます。ショート、オープンおよびロードの場合、正しいアライメントは各パッドの中央（Y軸、またはプローブ先端のスケート方向に対して）にあります。スルー/ライン標準器の場合、正しいアライメントは2つの対向するプローブが所定の距離で離れるように各ラインの端から10～15 μm 内側に設定します。

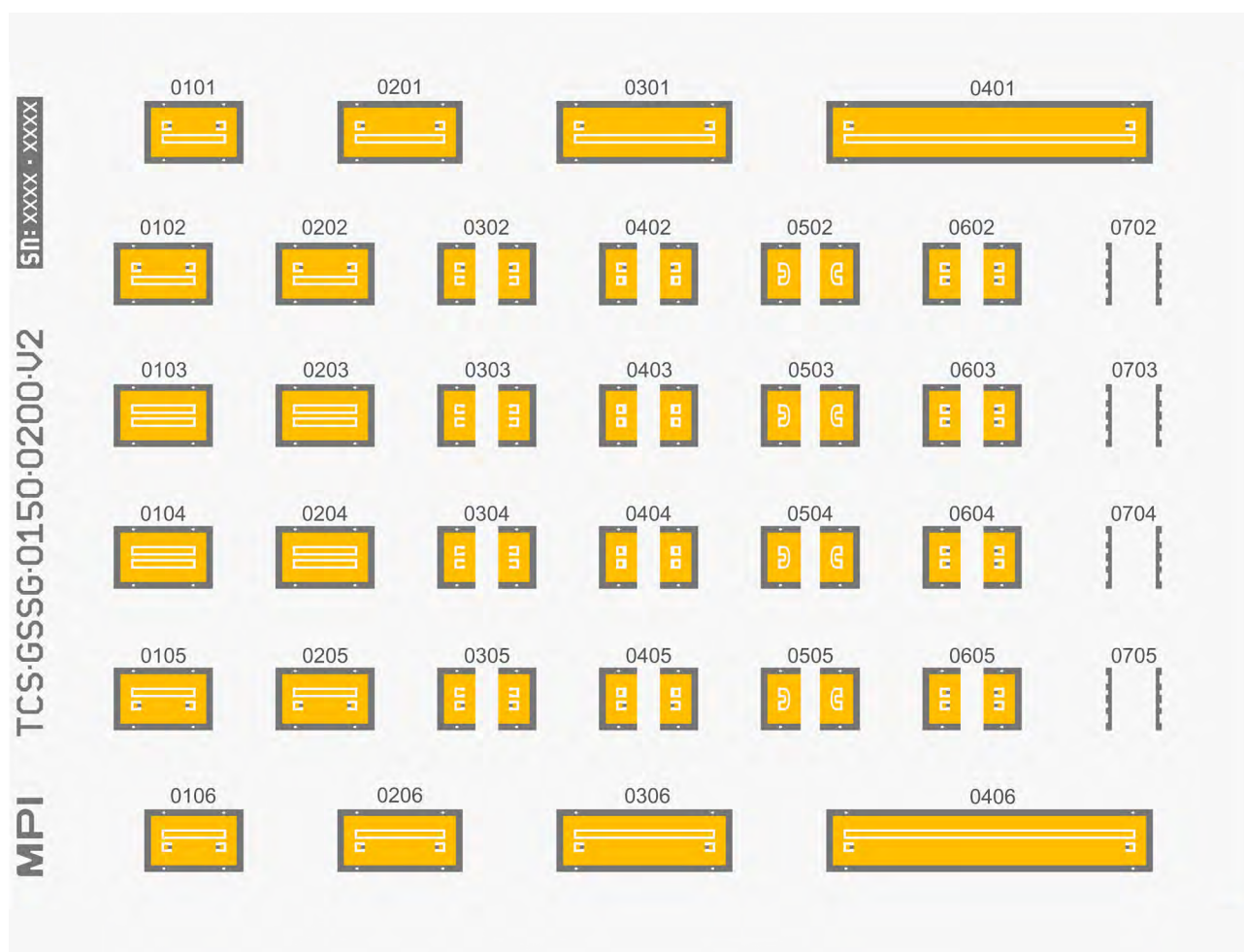
TCS校正基板の独特の鋸歯状のアライメントマーク（#0702 ～0705）と円錐形のアウトマーカは、プローブ先端と校正標準器のエッジを適切に設定するために設計されています。アライメント・マークのエッジ（下図の赤い破線で強調された部分）は、プローブのオーバトラベルが適切で、結果として10～15 μm のプローブ先端のスケートが生じたときに、ショート、オープン、ロードまたはスルー/ライン構造のエンドポイントに対応します。スケートは、プローブ先端が基板に初めて接触した時から始まります（下図の青い破線参照）。最初の先端接触はこの位置で行われます。

ユーザーは、青い破線とアウトマーカ・円錐を目安にして、10～15 μm のプローブ先端スケートを行うようにしてください。必要な垂直方向のオーバトラベルは最小量（通常20 μm 未満）で、プローブ先端が青い破線（鋸歯状の開口部の外側）から赤い破線（エッジで、鋸歯状の開口部には入らない）までスケートするのが理想です。これが正しく行われた場合、2つの対向するプローブは、赤い破線に位置しているときに、正しい物理的距離と回転方向のアライメントが保たれます（鋸歯状の開口部内に入らないで、エッジで止める）。



各構造物の近くにある三角形のマーカーは、スケート量15 μm や正確なチップの位置を確認するための物。

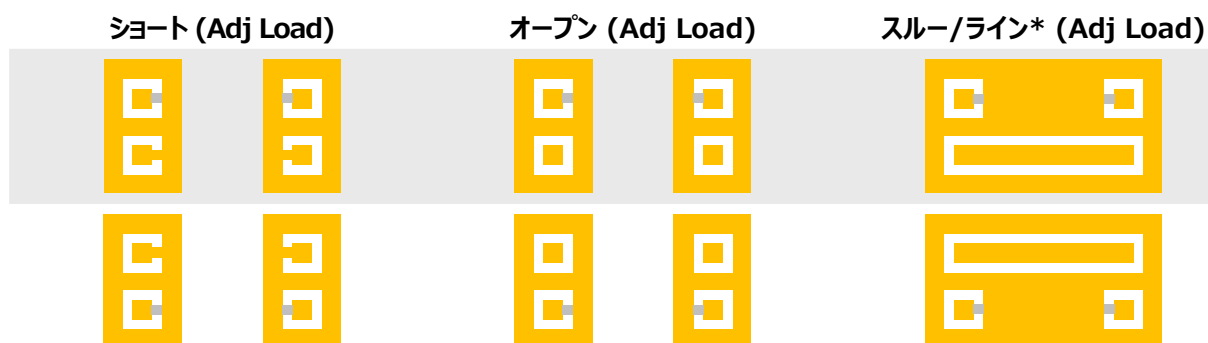
校正基板レイアウト



*位置基準エレメントは 0102

標準器エレメント

標準器 (隣接Load)



*ライン: 3種類の伝送ラインを用意。それらは異なる物理長および電気長を有する

デュアル標準器



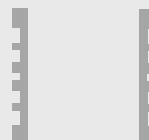
デュアル・ロード



バーティカル・スルー



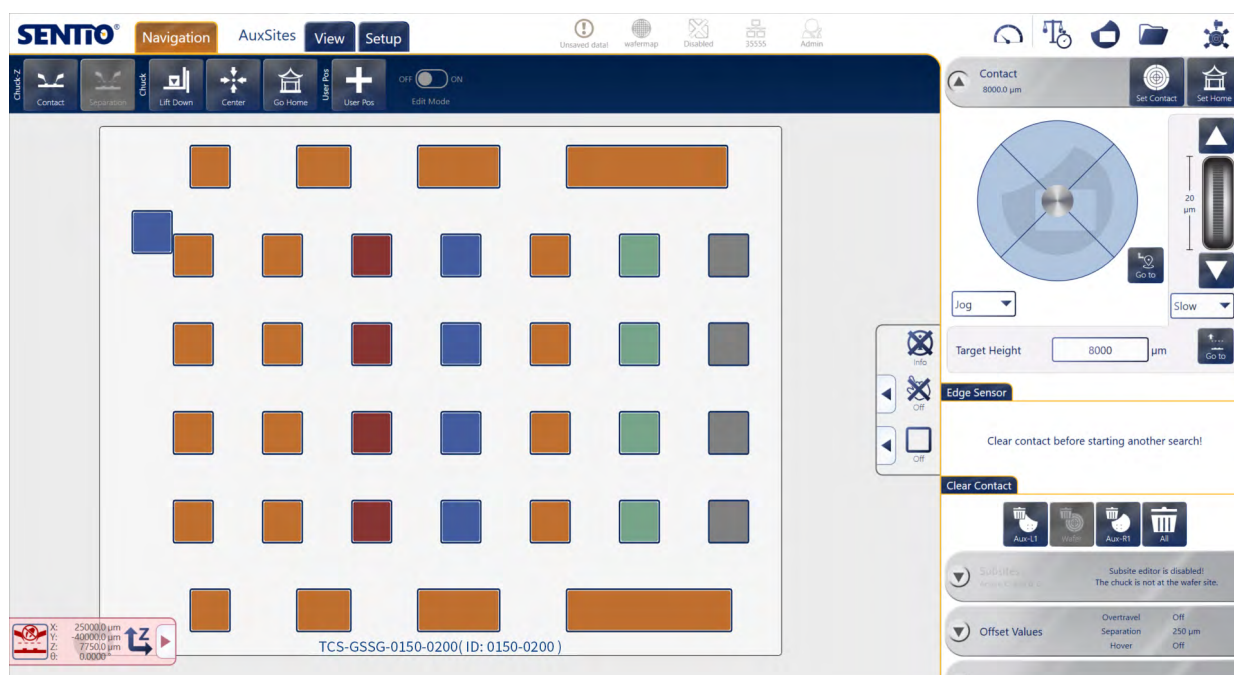
アライメント・マーク



SENTIO®による自動ナビゲーション

SENTIO®プローブステーション・ソフトウェアは、MPIが提供する強力なグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)を持つソフトウェアであり、半導体テストのレベルを次の基準に引き上げます。比類のない使いやすさ、マルチタッチ対応、そしてカスタマイズ可能なダッシュボードを備えたSENTIO®ソフトウェアは、RF測定とマイクロ波プローブRF校正をより効率的で生産的にするよう設計されています。ピクチャーインピクチャー機能とQAlibria®は高度なデータ分析ツールを提供し、内蔵のインテリジェンスがテストプロセスを合理化しプローブやデバイスを安全に保ちます。接続性とアップグレード機能により、常に最新の機能で接続され、そのスケーラビリティにより、SENTIO®ソフトウェアはビジネスの成長に合わせて拡張できます。SENTIO®とQAlibria®は、TCS校正基板の構造マッピングとシームレスに統合され、標準ナビゲーションが自動化され、経験の浅いオペレーターでも簡単にRF校正を行うことができます。

SENTIO®におけるTCS-GSSG-0150-0200基板マップ



-  Thru (Adj Load), Dual Thru, Vertical Thru, Line (Adj Load)
-  Short (Adj Load), Dual Short
-  Open (Adj Load), Dual Open, Open on bare ceramic or in Separation
-  Dual Load
-  Alignment Mark

標準器

スルー標準器 (隣接Load)

Name	Type	X μ m	Y μ m	Spacing μ m
0102	Thru (Adj Load)	0	0	750
0202	Thru (Adj Load)	2170	0	750
0105	Thru (Adj Load)	0	-5700	750
0205	Thru (Adj Load)	2170	-5700	750
0101	Thru (Adj Load)	410	1900	750
0106	Thru (Adj Load)	410	-7600	750

ライン標準器 (隣接Load)

Name	Type	X μ m	Y μ m	Spacing μ m
0201	Line1 (Adj Load)	3000	1900	1100
0301	Line2 (Adj Load)	5940	1900	1780
0401	Line3 (Adj Load)	9560	1900	3800
0206	Line1 (Adj Load)	3000	-7600	1100
0306	Line2 (Adj Load)	5940	-7600	1780
0406	Line3 (Adj Load)	9560	-7600	3800

ショート標準器 (隣接Load)

Name	Type	X μ m	Y μ m	Spacing μ m
0302	Short (Adj Load)	4340	0	750
0305	Short (Adj Load)	4340	-5700	750

オープン標準器 (隣接 Load)

Name	Type	X μ m	Y μ m	Spacing μ m
0402	Open (Adj Load)	6510	0	750
0405	Open (Adj Load)	6510	-5700	750

デュアル校正標準器

Name	Type	X μ m	Y μ m	Spacing μ m
0103	Dual Thru	0	-1900	750
0104	Dual Thru	0	-3800	750
0203	Dual Thru	2170	-1900	750
0204	Dual Thru	2170	-3800	750
0303	Dual Short	4340	-1900	750
0304	Dual Short	4340	-3800	750
0403	Dual Open	6510	-1900	750
0404	Dual Open	6510	-3800	750
0602	Dual Load	10850	0	750
0603	Dual Load	10850	-1900	750
0604	Dual Load	10850	-3800	750
0605	Dual Load	10850	-5700	750

バーティカル (Loop-Back) スルー標準器

Name	Type	X μm	Y μm	Spacing μm
0502	Vertical Thru	8680	0	750
0503	Vertical Thru	8680	-1900	750
0504	Vertical Thru	8680	-3800	750
0505	Vertical Thru	8680	-5700	750

プローブアライメント・エレメント

Name	Type	X μm	Y μm	Spacing μm
0702	Alignment Mark	13020	0	750
0703	Alignment Mark	13020	-1900	750
0704	Alignment Mark	13020	-3800	750
0705	Alignment Mark	13020	-5700	750

TITAN™デュアルプローブ校正係数**GSSG 構成**

Pitch	Model	C-Open, fF	L-Short, pH	L-Term, pH
150 μm	26, 40 GHz (標準タイプ)	7.5	48	39
200 μm	26, 40 GHz (標準タイプ)	7.4	48	36

GSSG 構成(Keysight VNA用)

Pitch	Model	C-Open, fF	L-Short, pH	Load*		
		C, fF	L, pH	R, Ohm	Offset Z_0 , Ohm	Offset delay, ps
150 μm	26, 40 GHz (標準タイプ)	7.5	48	50	500	0.079
200 μm	26, 40 GHz (標準タイプ)	7.4	48	50	500	0.073

*Offset Z_0 およびOffset delayを使用

参考文献

- [1] M. Spirito, U. Arz, G. N. Phung, F. J. Schmückle, W. Heinrich, and R. Lozar, "Guidelines for the design of calibration substrates, including the suppression of parasitic modes for frequencies up to and including 325 GHz," in "EMPIR 14IND02 – PlanarCal," Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), 2018.
- [2] H.-C. Fu, K. Jung. "Improve RF Dual Probe Calibration Accuracy with Peer-Terminated Standard", in 2024 IEEE / MTT-S International Microwave Symposium - IMS 2024, Washington, DC, USA, 16-24 June, 2024.

*詳しくはMPI取引条件をご参照ください。

Direct contact:
 Asia region: ast-asia@mpi-corporation.com
 EMEA region: ast-europe@mpi-corporation.com
 America region: ast-americas@mpi-corporation.com

MPI global presence: for your local support, please find the right contact here:
www.mpi-corporation.com/ast/support/local-support-worldwide

MPI Global Presence